МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 2023/2024 навчальний рік, прийому студентів 2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи

_____ Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО
"___"_____ 2023 р.

Спеціальність	174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка	Факультет/ННІ	Приладобудівний факультет
Освітня програма	Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні	Форма здобуття вищої освіти	*Очна*
Освітній ступінь	магістра	Строк навчання	1 рік 4 місяці
Випускова кафедра	*Кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем*	Кваліфікація	магістр з автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки

№ п/п	Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.)	Кафедра	К-ть здобув.		Обсяг дисциплін		Аудиторні години								СРС	Контрольні заходи								Розподіл аудиторних годин на тиждень за курсами і семестрами							
								Лекції		Практ. (комп. прк)		Лабор												1 курс							
																								ПГ-31мп (Б: 12, К: 5); ПО-31мп (Б: 12, К: 5);							
																								1 семестр				2 семестр			
																								18 тижнів				18 тижнів			
			Бюджет	Контракт	Кред ECTS	Години	Всього	за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять	Інд. зан.		Екзамени	Заліки	МКР	Курсові роботи	Курсові проекти	РГР,РР,ГР	ДКР	Реф.	Всього	у т.ч.			Всього	у т.ч.		
																									Лекц	Практ	Лаб		Лекц	Практ	Лаб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти																															
Цикл загальної підготовки																															
1	*Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 1. Право інтелектуальної власності*	КІВПП	24	10	1.0	30	18	12	-	6	-	-	-	0	12													1	0.67	0.33	
2	*Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 2. Патентознавство та набуття права*	КМ	24	10	2.0	60	36	24	-	12	-	-	-	0	24		2	2										2	1.33	0.67	
3	*Основи інженерії та технології сталого розвитку*	ШІ	24	10	2.0	60	36	18	-	18	-	-	-	0	24		2	2										2	1	1	
4	*Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації. Частина 1*	АМТС2	24	10	1.5	45	36	-	-	36	-	-	-	0	9			1					1	2		2					
5	*Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації. Частина 2*	АМТС2	24	10	1.5	45	36	-	-	36	-	-	-	0	9		2											2		2	
6	*Розробка стартап-проектів*	ЕК	24	10	3.0	90	54	18	-	36	-	-	-	0	36		1	1						3	1	2					
Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки					11	330	216	72	0	144	0	0	0	0	114	0	4	4	0	0	0	0	1	5	1	4	0	7	3	4	0
Цикл професійної підготовки																															
7	*Сучасна теорія управління*	КІОНС	24	10	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66	1		1						3	2	1					
8	*Математичне моделювання процесів та систем*	ВП	24	10	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66	1		1						3	2	1					
9	*Робототехніка та інтелектуальні системи*	АСНК	24	10	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78		1	1						4	2	2					
10	*Надійність і діагностика приладів і систем*	КІОНС	24	10	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78		1				1			4	2	2					
11	*Цифрова обробка сигналів та зображень*	КІОНС	24	10	5.5	165	72	36	-	36	-	-	-	0	93	1		1			1			4	2	2					
12	*Основи наукових досліджень*	ВП	24	10	2.0	60	27	9	-	18	-	-	-	0	33		1	1						1.5	0.5	1					
13	*Комп'ютерний зір*	КІОНС	24	10	4.5	135	54	18	-	36	-	-	-	0	81		2	2										3	1	2	
Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки					30	900	405	207	0	198	0	0	0	0	495	3	4	6	0	0	2	0	0	19.5	10.5	9	0	3	1	2	0
ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ					41	1230	621	279	0	342	0	0	0	0	609	3	8	10	0	0	2	0	1	24.5	11.5	13	0	10	4	6	0
2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти																															
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Ф-каталогів																															
14	*Космічні оптико-електронні системи* ‡	КІОНС	12	5	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		2	2										3	2	1	
15	*Військові оптичні та оптико-електронні прилади* ‡	КІОНС	12	5	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		2	2										3	2	1	
16	*Новітні прилади систем орієнтації та навігації* ‡	КІОНС	12	5	4.0	120	54	36	-	-	-	18	-	0	66		2	2										3	2		1
17	*Випробування і контроль приладів і систем* ‡	КІОНС	12	5	4.0	120	54	18	-	18	-	18	-	0	66		2	2										3	1	1	1
18	*Основи автоматизації технологічних процесів* ‡	АСНК	0	0	4.0	120	54	18	-	36	-	-	-	0	66		2	2										3	1	2	
19	*Методи та засоби цифрової обробки сигналів в автоматизованих системах* ‡	АСНК	0	0	4.0	120	54	18	-	-	-	36	-	0	66		2	2										3	1		2
20	*Робототехнічні комплекси в системах неруйнівного контролю* ‡	АСНК	0	0	4.0	120	54	36	-	18	-	-	-	0	66		2	2										3	2	1	
21	*Новітні системи та технології обробки сигналів* ‡	АСНК	0	0	4.0	120	54	36	-	-	-	18	-	0	66		2	2										3	2		1
22	*Технології віртуального виробництва* ‡	ВП	0	0	4.0	120	54	18	-	36	-	-	-	0	66		2	2										3	1	2	
23	*Методи оптимізації процесів і систем* ‡	ВП	0	0	4.0	120	72	36	-	36	-	-	-	0	48		2	2										4	2	2	
24	*Кріогенна медична техніка* ‡	ВП	0	0	4.0	120	54	18	-	36	-	-	-	0	66		2	2										3	1	2	
25	*Біометрія* ‡	ВП	0	0	4.0	120	72	36	-	36	-	-	-	0	48		2	2										4	2	2	
26	*Перетворення сигналів в оптико-електронних системах* ‡	КІОНС	12	5	5.0	150	72	54	-	18	-	-	-	0	78	2		2										4	3	1	
27	*Тепловізійні оптико-електронні прилади* ‡	КІОНС	12	5	5.0	150	72	36	-	18	-	18	-	0	78	2		2										4	2	1	1
28	*Проєктування оптичних систем* ‡	КІОНС	12	5	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	2		2										4	2	2	
29	*Інтелектуальні прецизійні мехатронні комплекси вимірювання параметрів*	АСНК	0	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	2		2										4	2	2	
30	*Основи інженерного експерименту*	АСНК	0	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	2		2										4	2	2	
31	*Інтегровані технології систем автоматизації випробувань*	АСНК	0	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	2		2										4	2	2	
32	*Комп'ютеризовані системи керування рухомими об'єктами*	КІОНС	12	5	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	2		2										4	2	2	
33	*Автоматичні системи орієнтації і стабілізації* ‡	КІОНС	12	5	5.0	150	72	36	-	-	-	36	-	0	78	2		2										4	2		2
34	*Навігаційні системи* ‡	КІОНС	12	5	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	2		2										4	2	2	
35	*Сучасні оптичні технології та системи* ‡	АСНК	0	0	5.0	150	72	36	-	18	-	18	-	0	78	2		2										4	2	1	1
36	*Мікроконтролери в системах неруйнівного контролю* ‡	АСНК	0	0	5.0	150	72	36	-	-	-	36	-	0	78	2		2										4	2		2
37	*Прилади та багатоканальні системи акустичного неруйнівного контролю* ‡	АСНК	0	0	5.0	150	72	36	-	18	-	18	-	0	78	2		2										4	2	1	1
38	*Автоматизована розробка керуючих програм* ‡	ВП	0	0	5.0	150	54	18	-	36	-	-	-	0	96	2		2										3	1	2	
39	*Моделювання параметрів автоматизованих систем* ‡	ВП	0	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	2		2										4	2	2	
40	*Діагностика засобів автоматизації технологічних процесів* ‡	ВП	0	0	5.0	150	72	36	-	18	-	18	-	0	78	2		2										4	2	1	1
41	*Аналіз вимірювальних сигналів*	ВП	0	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	2		2										4	2	2	
42	*Генезис біосигналів*	ВП	0	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	2		2										4	2	2	
43	*Біофотоніка* ‡	ВП	0	0	5.0	150	72	36	-	-	-	36	-	0	78	2		2										4	2		2
44	*Інформаційно-вимірювальні технології в галузі енергозбереження* ‡	АСНК	0	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	2		2										4	2	2	
45	*Моделювання процесів і систем в енергозбереженні* ‡	АСНК	0	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	2		2										4	2	2	
46	*Інтегровані технології оцінки відповідності вимірювальних приладів і систем у енергозбереженні* ‡	АСНК	0	0	5.0	150	72	36	-	36	-	-	-	0	78	2		2										4	2	2	
Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки					23	690	324	180	0	144	0	0	0	0	366	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	10	8	0
ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ					23	690	324	180	0	144	0	0	0	0	366	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	10	8	0
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:					64	1920	945	459	0	486	0	0	0	0	975	6	10	15	0	0	2	0	1	24.5	11.5	13	0	28	14	14	0

Кількість													
Кількість екзаменів	6	3				3							
Кількість заліків	10		4				6						
МКР	15			7				8					
Курсових робіт	0												
Курсових проєктів	0												
РГР, РР, ГР	2		2										
ДКР	0												
Рефератів	1				1								

‡ Виконано перерозподіл аудиторних годин

Ухвалено на засіданні Вченої ради ПБФ ПРОТОКОЛ № _____ від _____

Завідувач кафедри КІОНС _____ Надія БУРАУ
(підпис)

Декан факультету (директор інституту) _____ Григорій ТИМЧИК
(підпис)

Примітка: РНП є частиною навчального плану і формується на основі аналізу сукупності індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на поточний навчальний рік;